

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ И ПЛЁНКИ

PACS numbers: 61.43.-j, 64.70.kd, 81.15.Pq, 81.30.Hd, 81.40.Ef

О механизме формирования рентгеноаморфной структуры плёнок сплавов Ni–W

Т. А. Точицкий, А. Э. Дмитриева

*ГО «НПЦ НАН Беларусь по материаловедению»,
ул. П. Бровки, 19,
220072 Минск, Беларусь*

Изучена структура электроосаждённых плёнок сплавов Ni–W. Показано, что при увеличении содержания в осадках вольфрама до 20% ат. происходит фазовый переход из поликристаллического в рентгеноаморфное состояние. Указан механизм формирования рентгеноаморфной структуры плёнок.

Вивчено структуру електроосаджених плівок стопів Ni–W. Показано, що при збільшенні вмісту в осадах вольфраму до 20% ат. відбувається фазовий перехід із полікристалічного у рентгеноаморфний стан. Зазначено механізм формування рентгеноаморфної структури плівок.

The structures of the electrodeposited Ni–W-alloy films are investigated. As shown, at increasing a tungsten precipitation up to 20% at. in the deposit, the polycrystalline-to-X-ray-amorphous-state phase transition occurs. The formation mechanism of X-ray amorphous structure of films is suggested.

Ключевые слова: электролитические плёнки, субструктура, кристаллическая решётка.

(Получено 1 ноября 2013 г.)

1. ВВЕДЕНИЕ

Электролитически осажденные аморфные пленки сплавов Ni–W характеризуются высокой твердостью, повышенной износостойкостью, коррозионной и электроэрозийной стойкостью [1, 2]. В последнее время к аморфным пленкам значительно возрос интерес в связи с возможностью формирования на их основе магнитных нанокристаллических структур [3]. Физико-механические свойства осадков определяются внутренним строением и фазовым составом пленок.

Ранее при исследовании строения пленок сплавов Ni–W на рентгенограммах и электронограммах было установлено наличие дополнительных линий, которые не относятся к ГЦК-решетке никеля [1]. С целью индицирования дополнительных рефлексов в настоящей работе было продолжено рентгенографическое исследование структуры и механизма ее формирования в пленках Ni–W в зависимости от содержания W в осадках и температуры изотермического отжига.

2. МЕТОДИКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Электролитически осажденные пленки сплавов Ni–W толщиной 1 мкм были получены из сернокислых растворов с добавлением вольфрамата и цитрата натрия. Параметры электролиза кислотность pH, плотность катодного тока i_k и температура электролита T поддерживались в следующих пределах: pH 6–7, $i_k = 5\text{--}20 \text{ mA/cm}^2$, $T = 20\text{--}30^\circ\text{C}$. В качестве подложек использовалась медная полированная фольга толщиной 0,1 мкм. Структурные исследования выполнены с помощью рентгеновского дифрактометра «ДРОН-3М» в кобальтовом $\text{Co}K_\alpha$ -излучении. Размер областей когерентного рассеяния рентгеновских лучей $L_{\text{окр}}$ определяли методом четвертого момента [4]. Методика подготовки образцов для исследований приведена в работе [5]. Химический состав пленок определен на ожеспектрометре «Perkin-Elmer» PHI-660.

В исходном состоянии (pH 6–7, $i_k = 5 \text{ mA/cm}^2$) пленки никеля (ГЦК-решетка) имеют текстуру с осью [111]. Легирование пленок никеля вольфрамом до 2% ат. приводит к образованию мелкокристаллического ($\approx 50 \text{ нм}$) строения и появлению дополнительной оси текстуры [100] (рис. 1). При увеличении содержания вольфрама до 14% ат. растет период кристаллической решетки сплава от 0,3557 нм до 0,3590 нм, что свидетельствует об образовании твердого раствора замещения на основе ГЦК-решетки никеля. На рентгенограммах пленок, содержащих 12–17% ат. W, присутствует слабой интенсивности дополнительная линия ($2\theta = 48,2^\circ$), которая не относится к ГЦК-решетке сплава. Ранее было установлено [1], что при легировании никеля вольфрамом (до 19% ат. W) кристаллиты сплава ($\approx 50 \text{ нм}$) разбиваются на чередующиеся микрообласти (последовательность 2–10 нм): с ориентацией [111], обогащенные никелем, и с ориентацией [100], обогащенные вольфрамом. В микрообластях первого типа в твердом растворе на основе ГЦК-решетки образуются дефекты упаковки, концентрация которых по мере увеличения содержания вольфрама возрастает. В результате этого последовательность укладки атомных слоев (111) становится случайной ACBCBACAB... и на таких участках формируются аморфные прослойки. В микрообластях второго типа (с ориентацией [100]) образуется случайная плотная упаковка атомов сплава. На рентгено-

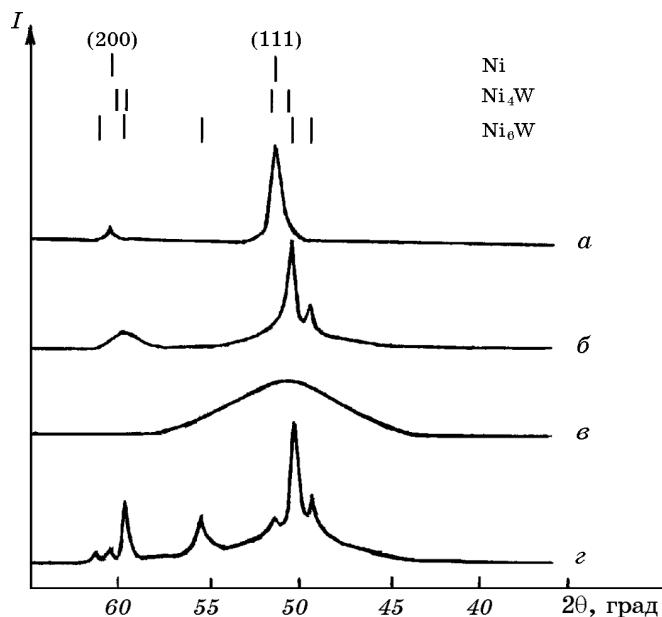


Рис. 1. Рентгенограммы пленок чистого никеля (*α*), сплавов Ni–W, содержащих 17 (*β*), 20% ат. W (*γ*, *ε*). Пленки (*α*–*γ*) в исходном состоянии и после отжига при 600°C (*ε*).

граммах сплава Ni–W при содержании вольфрама более 19% ат., имеется только один дифракционный максимум — гало, а на электронно-микроскопических (ЭМ) снимках наблюдается негомогенная, ячеистая (сеточная) микроструктура с размером ячеек ≥ 50 нм [1]. В таких пленках $L_{\text{окр}}$ составляет примерно 1 нм. Изотермический отжиг аморфных пленок (содержащих 19–23% ат. W) приводит к появлению на рентгенограммах ряда дополнительных линий (см. рис. 1, *ε*). Результаты расчета и индицирования рентгенограмм пленок сплава (≥ 20 % ат. W), отожженных при 500–600°C показывают, что часть линий можно отнести к соединению Ni₄W с тетрагональной решеткой, а другую часть — к соединению Ni₆W с ГПУ-решеткой (см. рис. 1 и табл.). Вследствие близости межплоскостных расстояний обоих соединений некоторые линии, например, (00.2) и (211), (10.2) и (130) совпадают (см. рис. 1 и табл.). Расчет показывает, что в отожженных пленках имеются две области когерентного рассеяния рентгеновских лучей: $L_{\text{окр}} \cong 2$ нм и $L_{\text{окр}} \cong 10$ нм.

3. ОБСУЖДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Процесс формирования указанной структуры пленок Ni–W можно описать с использованием такого показателя, как элементарная ра-

ТАБЛИЦА. Результаты расчета и индицирования рентгенограммы пленки сплава Ni–W ($\approx 20\%$ ат. W), отожженной при температуре 600°C.

$\text{Ni}_4\text{W}, c/a = 0,62^*$			$\text{Ni}_6\text{W}, c/a = 0,82^{**}$		
2θ, град	d , нм	hkl	2θ, град	d , нм	hkl
60,5	0,177	002	62,5	0,170	12.0
59,2	0,181	130	59,2	0,1814	10.2
52,4	0,202	220	55,3	0,1931	20.1
51,0	0,207	211	50,6	0,209	00.2
			48,2	0,2196	20.0

* $c = 0,3553$, $a = 0,573$ нм; ** $c = 0,418$, $a = 0,509$ нм.

бота присоединения (отрыва) атомов из разных положений растущего кристалла.

Известно [6], что вероятность P присоединения атома к кристаллу в любом положении зависит от энергии связи атома E в этом положении, т.е. $P \propto \exp(E/kT)$. Энергия связи присоединяющегося атома к плотноупакованной грани (111) ГЦК-решетки в положении равновесия (потенциальной яме) максимальна по сравнению с другими положениями грани [7]. В связи с этим наиболее вероятно, что чужеродный атом вольфрама присоединится к грани (111) никеля в потенциальной яме (рис. 2, *a*, положение 1). Поскольку атомный радиус вольфрама ($r_{\text{W}} = 0,141$ нм) больше на 14%, чем атомный радиус никеля ($r_{\text{Ni}} = 0,125$ нм), то при формировании моноатомного слоя В присоединяющиеся атомы вынуждены смещаться из равновесных положений: атомы Ni на 7%, а атомы W на $\approx 14\%$. Поэтому, согласно механизму [6, 7], энергия связи атомов вольфрама, а также вероятность их присоединения меньше, чем атомов никеля. Вторыми соседями также будут атомы никеля, так как они смещаются на $\approx 7\%$, а атомы вольфрама — на $\approx 14\%$. Третьими соседями могут быть как атомы Ni, так и атомы W, поскольку атомы обоих металлов смещаются от положения равновесия на $\approx 7\%$. Четвертые соседи, как атомы Ni, так и атомы W смещаются от положения равновесия в направлениях $\langle 2\bar{1}\bar{1} \rangle$, $\langle 1\bar{2}1 \rangle$ и $\langle 211\bar{1} \rangle$ более чем на 14%, а в направлениях $\langle \bar{1}2\bar{1} \rangle$, $\langle \bar{1}\bar{1}2 \rangle$ и $\langle \bar{2}11 \rangle$ атомы Ni попадают в двойниковые положения (рис. 2, положение 2). Сформировавшаяся таким образом грань сплава Ni–W на грани (111) Ni имеет химический состав 85,7% Ni и 14,3% W (Ni_6W). В тангенциальном направлении размер грани с таким химическим составом, по-видимому, определяется в основном четвертыми соседями (≈ 2 нм), поскольку в направлениях $\langle 2\bar{1}\bar{1} \rangle$, $\langle 1\bar{2}1 \rangle$ и $\langle 11\bar{2} \rangle$ вероятность присоединения атомов, согласно механизму [6, 7], мала, а в направлениях $\langle \bar{1}2\bar{1} \rangle$, $\langle \bar{1}\bar{1}2 \rangle$ и $\langle \bar{2}11 \rangle$ могут образоваться дефекты уп-

ковки (ДУ) или микродвойники [7]. Ранее проведенные ЭМ исследования показали [1], что действительно такие пленки в направлении плоскости осадка имеют структурные неоднородности размером до 2 нм.

Согласно данным [8] вольфрам с никелем может образовать соединение Ni_{17}W_3 (85% Ni и 15% W) с ГЦК-решеткой. Однако, поскольку с увеличением содержания вольфрама растет концентрация ДУ и нарушается порядок укладки граней 85,7% Ni и 14,3% W, то как соединение Ni_{17}W_3 с ГЦК-решеткой, так и соединение Ni_6W с ГПУ-решеткой не образуются (рис. 2, б). Так как ДУ в ГЦК-решетке имеют гексагональную упаковку атомов, то при высокой концентрации ДУ в осадке на рентгенограмме образуется линия с

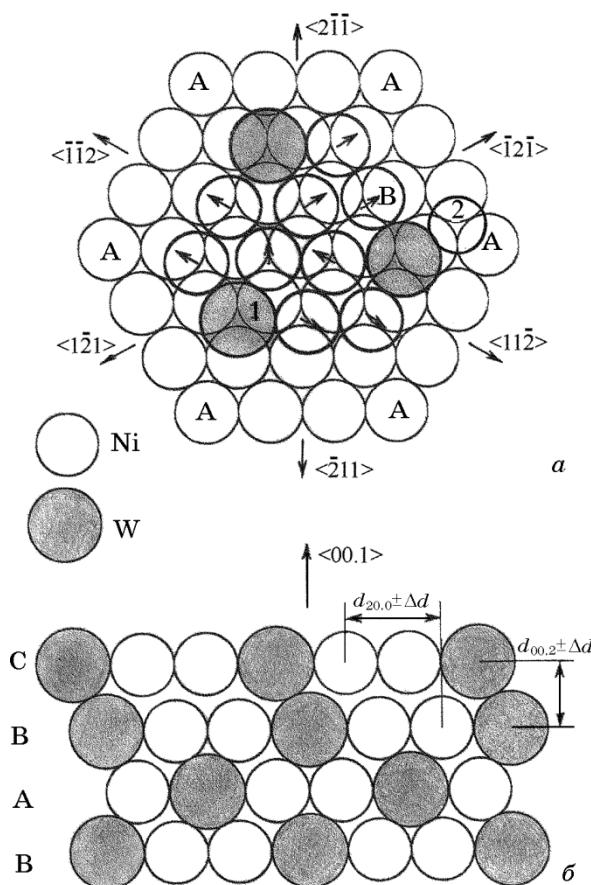


Рис. 2. Схемы формирования граней кристалла сплава 85,7Ni–14,3W на грани (001) ГЦК-решетки никеля (а) и укладки их в направлении <00.1> (б). Границы параллельны (а) и перпендикулярны (б) плоскости рисунка. Стрелками указано смещение атомов на $\approx 7\%$ от положения равновесия.

$20 = 48,2^\circ$, которую, как показывают исследования отожженных пленок, можно отнести к линии (200) гексагональных прослоек (см. рис. 1, б и таблицу). По-видимому, размер $L_{\text{окр}} \approx 1 \text{ нм}$ характеризует толщину прослоек ДУ в перпендикулярном к плоскости пленки направлении.

Дополнительная ось текстуры [100] образуется в результате двойникования на наклонных ($70,5^\circ$) гранях (111) матрицы с текстурой [111] [8]. При этом грани (001) двойников располагаются под углом $19,5^\circ$ к плоскости пленки (рис. 3). На этих участках кристаллитов может присоединиться больше атомов вольфрама. Так, если присоединился атом вольфрама к грани (001) ГЦК-решетки, то, согласно механизму [6, 7], его первыми соседями становятся атомы никеля (4

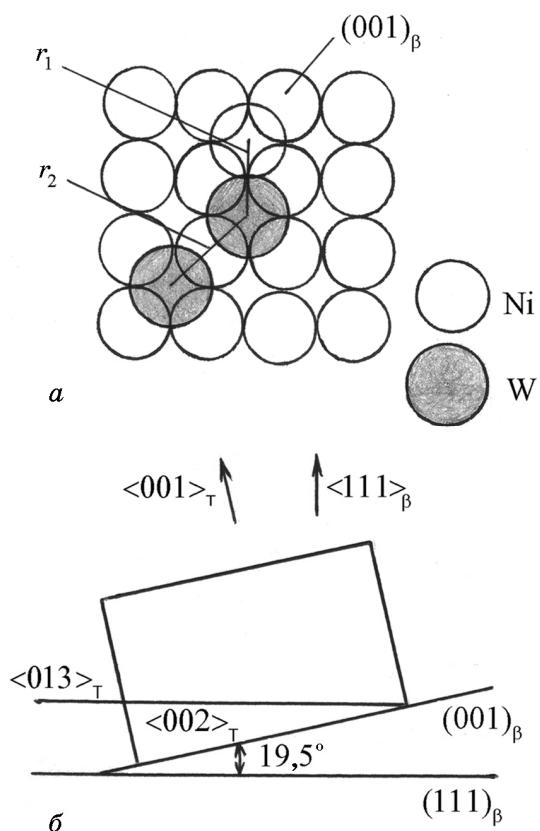


Рис. 3. Двумерная модель присоединения атомов к грани (001) ГЦК-решетки никеля (а) и схема формирования соединения Ni_4W (б); r_1 и r_2 — расстояния от присоединяющегося атома до первых и вторых соседей соответственно; β -ГЦК-решетка никеля; T — тетрагональная решетка соединения Ni_4W . Границы параллельны (а) и перпендикулярны (б) плоскости рисунка.

атома). Вторыми соседями могут быть как атомы никеля, так и атомы вольфрама, так как их присоединение к грани (001) происходит без смещения от положения равновесия (рис. 3). В этом случае наиболее вероятно, что на грани (001) ГЦК-решетки никеля может образоваться грань соединения Ni_4W с тетрагональной решеткой, так как межплоскостные расстояния (200) ГЦК-решетки никеля (0,1765 нм) близки к d_{002} (0,1776 нм) соединения Ni_4W . Известно [9], что при переходе от ГЦК-решетки к тетрагональной решетке линия (310) ГЦК-решетки разбивается на ряд линий (013), (103) и (301), межплоскостные расстояния которых отличаются незначительно. Поэтому имеющуюся широкую линию на рентгенограмме с $2\theta = 59,2^\circ$ можно отнести к отражению от указанного семейства линий тетрагональной решетки прослоек соединения Ni_4W . По мере увеличения содержания вольфрама в осадке происходит перестройка микрообластей с соединением Ni_4W . Крупные атомы вольфрама, внедряясь в решетку соединения, существенно ее деформируют, нарушая близкий порядок. В связи с этим, в указанных микрообластях образуется случайная плотная упаковка атомов.

В пользу мнения о том, что аморфные пленки сплавов Ni–W имеют гетерогенное строение, свидетельствуют также данные изотермического отжига, в результате которого пленки переходят из аморфного в кристаллическое состояние [1]. На рентгенограмме пленки, отожженной при 300°C , первой появляется линия (130) соединения Ni_4W (рис. 1, 2). Причем в этом случае линия является узкой, в отличие от такой же линии пленки до отжига (рис. 1, б).

Образование соединения Ni_6W с ГПУ-решеткой энергетически более выгодно, чем соединения Ni_{17}W_3 с ГЦК-решеткой, поскольку в направлении нормали грани 85,7% Ni и 14,3% W более плотно укладываются в гексагональную упаковку атомов (см. рис. 2, ВАВ), чем гранецентрированную кубическую (рис. 2, АВС). При этом на рентгенограмме наибольшую интенсивность имеет линия (00.2). Последнее свидетельствует о том, что как случайно чередующиеся грани 85,7% Ni и 14,3% W в исходном состоянии пленок, так и прослойки соединения Ni_6W , образовавшиеся после отжига, расположены параллельно плоскости пленки. Поэтому ввиду сильной текстурированности пленок часть линий обоих соединений на рентгенограммах отсутствует. Большой размер $L_{\text{окр}}$ (≈ 10 нм) в таких пленках можно отнести к соединению Ni_6W , так как интенсивность линий на рентгенограмме указанного соединения больше, чем линий соединения Ni_4W ($L_{\text{окр}} \approx 2$ нм).

4. ВЫВОДЫ

1. Проведенное исследование позволяет утверждать, что при легировании вольфрамом пленок никеля с текстурой [111] реализуется

переход «поликристаллическое–аморфное» состояние пленок сплавов Ni–W по схеме: кристаллит ГЦК → агрегат (ГЦК, ГПУ) → ячейка (рентгеноаморфное строение).

2. Ячейка рентгеноаморфных пленок Ni–W состоит из областей (до 2 нм), одни из которых обогащены никелем и имеют случайную упаковку атомных плоскостей состава 85,7Ni14,3W, а другие обогащены вольфрамом и имеют случайную плотную упаковку атомов.
3. В результате изотермического отжига рентгеноаморфных пленок в обогащенных никелем областях ячеек образуется соединение Ni_6W , а в обогащенных вольфрамом областях — соединение Ni_4W .

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. С. С. Грабчиков, *Аморфные электролитически осажденные металлические сплавы* (Минск: Изд. центр БГУ: 2006).
2. А. Т. Васько, *Электрохимия молибдена и вольфрама* (Киев: Наукова думка: 1977).
3. P. Quintaka and E. Amoko, *J. Appl. Phys.*, **75**: 6940 (1994).
4. Я. Д. Вешняков, А. Н. Иванов, М. Н. Перегудов, *Кристаллография*, **13**, № 6: 1093 (1968).
5. С. С. Грабчиков, Л. Б. Сосновская, *Изв. РАН. Сер. Металлы*, **5**: 95 (2002).
6. А. А. Степанова, Н. Н. Шефтель, *Рост кристаллов* (Москва: Наука: 1972).
7. Т. А. Точицкий, *Изв. РАН. Сер. Металлы*, **4**: 80 (2009).
8. Т. А. Точицкий, С. С. Грабчиков, Л. Б. Сосновская и др., *Поверхность*, **10**: 101 (2005).
9. С. С. Горелик, Л. Н. Растворгувев, Ю. А. Скаков, *Рентгенографический и электроннооптический анализ* (Москва: Металлургия: 1970).